

⑫ 公開実用新案公報 (U) 平3-38636

⑬ Int. Cl.⁵

H 01 L 21/68

識別記号

A

庁内整理番号

7454-5F

⑭ 公開 平成 3 年 (1991) 4 月 15 日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2 頁)

⑮ 考案の名称 基板処理装置

⑯ 実 願 平1-99460

⑰ 出 願 平 1 (1989) 8 月 25 日

⑱ 考 案 者 大 神 信 敏 京都府京都市伏見区羽束師古川町322番地 大日本スクリーン製造株式会社洛西工場内

⑲ 考 案 者 杉 本 憲 司 京都府京都市伏見区羽束師古川町322番地 大日本スクリーン製造株式会社洛西工場内

⑳ 出 願 人 大日本スクリーン製造株式会社 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る 4 丁目天神北町 1 番地の 1

㉑ 代 理 人 弁理士 北 谷 寿一

㉒ 実用新案登録請求の範囲

複数種の基板処理ユニットと、各基板処理ユニットへ基板を給排する自走式基板搬送手段とを具備して成る基板処理装置において、

少なくとも 1 以上の基板処理ユニットに定置式基板移載手段を付設配置し、定置式基板移載手段は、当該処理ユニットの処理完了後、自走式基板搬送手段が当該処理ユニットに到着していない時、自走式基板搬送手段が受取り可能になるまで、当該処理ユニットによる処理済み基板をバツ

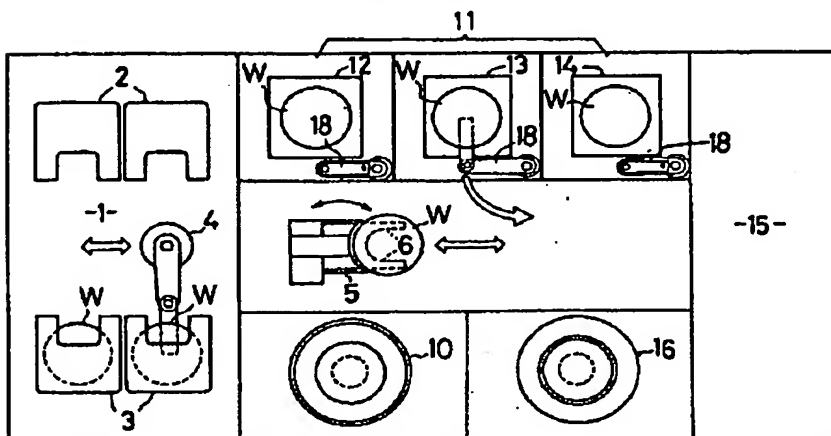
フアスペースへ停留させるように構成したことを特徴とする基板処理装置。

図面の簡単な説明

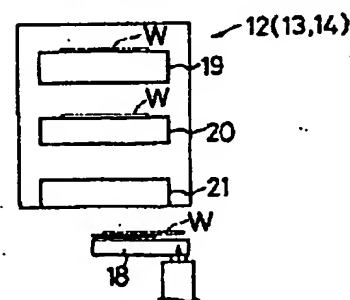
第 1 図は本考案に係る基板処理装置の模式的平面図、第 2 図は熱処理部を構成する各ユニットの 1 例を示す正面図、第 3 図は従来例の模式的平面図である。

5…自走式基板搬送手段、10～16…基板処理ユニット、18…定置式基板移載手段。

第 1 図



第 2 図



公開実用平成 3-38636

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U) 平3-38636

⑬ Int. Cl.³

H 01 L 21/68

識別記号

A

庁内整理番号

7454-5F

⑭ 公開 平成 3 年(1991) 4 月15日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

⑮ 考案の名称 基板処理装置

⑯ 実 願 平1-99460

⑰ 出 願 平 1 (1989) 8 月25日

⑱ 考 案 者 大 神 信 敏 京都府京都市伏見区羽束師古川町322番地 大日本スクリーン製造株式会社洛西工場内

⑲ 考 案 者 杉 本 憲 司 京都府京都市伏見区羽束師古川町322番地 大日本スクリーン製造株式会社洛西工場内

⑳ 出 願 人 大日本スクリーン製造株式会社 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る 4 丁目天神北町 1 番地の 1

㉑ 代 理 人 弁理士 北 谷 寿 一